

# RAITH VOYAGER 電子束微影系統 考核項目表

## 一、 前置作業檢查

1. 機台是否可以作業.....
2. 機台冷卻系統檢查.....
3. Sample Holder 表面檢查.....

## 二、 Sample Holder 載入與退出程序

1. Sample Holder 載入執行程序.....
2. Sample Holder 退出執行程序.....

## 三、 如何設定 beam condition 與 writer field

## 四、 如何使用標準 mark(pillar & chessy)做曝光前校正

1. 如何調整 beam focus 與 stigmator ( pillar sample ).....
2. 如何調整 writing field stitching ( chessy sample ).....
3. 如何對測定 beam current .....

## 五、 如何設定對準 mark 與燒點

1. 如何設定 alignment mark .....
2. 如何燒點校正 writing field.....

## 六、 設定曝光參數

1. 如何設定 dose factor .....
2. 如何設定曝光劑量.....
3. 計算曝光時間與執行曝光.....

## 七、 其他

1. 光阻注意事項.....
2. Sample 注意事項 .....
3. 其他注意事項.....